PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-256631

(43) Date of publication of application: 21.09.2001

(51)Int.CI.

G11B 5/65 G11B 5/64 G11B 5/851 H01F 10/14 H01F 10/16 H01F 10/26 H01F 41/16

(21)Application number: 2000-300906

(22)Date of filing:

29.09.2000

(71)Applicant : NARUSE ATSUSHI

(72)Inventor: KITAGAMI OSAMU

SHIMADA HIROSHI

(30)Priority

Priority number: 200000544

Priority date: 05.01.2000

Priority country: JP

(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-density recording medium, having improved thermal and temporal stability of the recording state and superior reliability, and to provide a method of manufacturing the medium.

SOLUTION: In the magnetic recording medium, having a ferromagnetic particle layer consisting of ferromagnetic particles formed on the substrate (or on a base layer on the substrate) or having a ferromagnetic particle layer, formed by growing ferromagnetic particles in a nonmagnetic matrix on the substrate, the ferromagnetic particles have a CuAu regular structure, consisting of the composition of F1-xMx (where F represents Fe or Co and M represents Pd, Ir or Pt) and contains a nonmagnetic additive element Y (where Y is Ag, In, Au, Pb, Bi, Sn or Sb) by 0.3 atomic abundance ratio with respect to F1-xMx.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (J.P) . (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-256631 (P2001-256631A)

(43)公開日 平成13年9月21日(2001.9.21)

(51) Int.Cl.7		識別記号	ΡI					テ	マコート*(参考)
G11B	5/65		G 1 1	B	5/65				5 D O O 6
	5/64				5/64				5 D 1 1 2
	5/851				5/851				5 E O 4 9
H01F	10/14		H 0 1	١F	10/14				
	10/16				10/16				
		審查請求	未請求	計成	項の数16	OL	(全 7	7 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号 特願2000		特願2000-300906(P2000-300906)	(71)	出願人	3990578	827		·	
					成瀬	淳			
(22)出顧日		平成12年9月29日(2000.9.29)	1 7			申奈川県小田原市城山3-8-13-110			
			(72) 5	発明者	新北上 1	修			
(31)優先権主張番号		特願2000-544(P2000-544)	宮城県仙台市泉区館一丁目6番16号				6番16号		
(32)優先日		平成12年1月5日(2000.1.5)	(72) §	発明者	1 島田 1	寛			
(33)優先権主張国		日本 (JP)			宮城県	仙台市	青葉区	桜ケ丘−	七丁目37番10号
			(74)	代理人	100088	096			
					弁理士	福森	久夫		
									最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁気記録媒体およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 記録状態の熱的、経時的安定性を高め、信頼性に優れた高密度記録媒体およびその製造方法を提供すること。

【解決手段】基体上(あるいは基体上の下地層上)に形成された強磁性粒子からなる強磁性粒子層、または基体上の非磁性マトリクス中に強磁性粒子が成長してなる強磁性粒子層を有する磁気記録媒体において、前記強磁性粒子が $F_{1-x}M_x$ (F:Fe、Co、M:Pd、Ir、Pt)の組成からなるCuAu型規則構造を有し、かつ前記 $F_{1-x}M_x$ に対する原子存在比率が0.3以内の非磁性添加元素Y(Y:Ag、In、Au、Pb、Bi、Sn、Sb)が含有されていることを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体上(あるいは基体上の下地層上)に 形成された強磁性粒子からなる強磁性粒子層、または基 体上の非磁性マトリクス中に強磁性粒子が成長してなる 強磁性粒子層を有する磁気記録媒体において、

1

前記強磁性粒子がF_{1-x}M_x(F:Fe、Co、M:P d、Ir、Pt)の組成からなるCuAu型規則構造を 有し、かつ前記F₁₋₁M₂に対する原子存在比率が0.3 以内の非磁性添加元素Y(Y:Ag、In、Au、P b、Bi、Sn、Sb) が含有されることを特徴とする 10 磁気記録媒体。

【請求項2】 F_{1-x} M_x に対するYの原子存在比率が 0.01~0.3の範囲にあることを特徴とする請求項 1 に記載の磁気記録媒体。

F_{1-x}M_xに対するYの原子存在比率が 【請求項3】 0.03~0.2の範囲にあることを特徴とする請求項 1記載の磁気記録媒体。

【請求項4】 結晶主軸が主に膜面法線方向にあること を特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の 磁気記録媒体。

【請求項5】 前記非磁性マトリクスは炭化物、窒化 物、酸化物またはこれらの混合物からなることを特徴と する請求項1ないし4のいずれか1項に記載の磁気記録 媒体。

【請求項6】 前記非磁性マトリクスはSiO,, Mg O. A 1, O, In, O, のいずれか 1 種以上からなるこ とを特徴とする請求項5記載の磁気記録媒体。

【請求項7】 $x = 0.40 \sim 0.65$ であることを特 徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載の磁気 記錄媒体。

【請求項8】 前記強磁性粒子層の厚さが100 n m 以 下であることを特徴とする請求項1ないし7のいずれか 1項に記載の磁気記録媒体。

【請求項9】 前記基体は熱膨張係数が2×10-5/℃ 以下であることを特徴とする請求項1ないし8のいずれ か1項に記載の磁気記録媒体。

【請求項10】 前記基体は、表面酸化Siウエハ、溶 融石英基体、ガラス基体であることを特徴とする請求項 1ないし8のいずれか1項に記載の磁気記録媒体。

【請求項11】 前記下地層は、C、Si、酸化物、炭 40 化物、窒化物から層であることを特徴とする請求項1な いし10のいずれか1項に記載の磁気記録媒体。

【請求項12】 強磁性体F_{1-x}M_x(F:Fe、Co、 M:Pd、Ir、Pt)、非磁性添加元素Y(Y:A g、In、Au、Pb、Bi、Sn、Sb) を同時に基 体上(あるいは基体上の下地層上)に堆積させることを 特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項13】 強磁性体F,_,M,(F:Fe、Co、 M:Pd、Ir、Pt)、非磁性添加元素Y(Y:A g、ln、Au、Pb、Bi、Sn、Sb)、及び非碰 50 少なくともこの程度のサイズまで微小な高密度記録が可

性マトリクス材料を同時に基体上に堆積させることを特 徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項14】 強磁性体F...M.(F:Fe、Co、 M: Pd、Ir、Pt)、及びF₁₋₁M_{*}に対する原子存 在比率が0.3以内であることを特徴とする請求項12 または13に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項15】 堆積時の基体温度を300℃~600 ℃とすることを特徴とする請求項12ないし14のいず れか1項に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項16】 堆積後の熱処理を300℃~600℃ で行うことを特徴とする請求項12ないし14のいずれ か1項に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は高密度磁気記録媒体およ びその製造方法に係り、更に詳しくは、その熱的安定性 および経時的安定性に優れた磁気記録媒体およびその製 造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】情報社会の発展に伴い、高密度記録技術 の開発が切望されている。特に、ビット単価が安く、不 揮発かつ大容量記録の可能な磁気記録においては、高密 度記録の可能な磁気記録媒体の開発が強く要求され、種 々の研究開発によりこと数年で著しい髙密度化が実現さ れた。しかし、将来的に更なる進化が期待される情報化 社会において、例えば十年、二十年先の市場要求に対応 できる技術的見通しは殆ど得られていない。

【0003】この技術的行き詰まりの最も大きな原因の 一つに、現行磁気記録媒体が抱える以下のような原理的 30 問題がある。現行の磁気記録媒体用薄膜は、СоСrを 主体とする合金薄膜であるが、この薄膜においては磁性 を担う微小領域の磁気的分離が不十分なため、磁気的に 結合した比較的に大きな磁気集団 (クラスター) が形成 される。そのサイズは凡そサブミクロンからミクロンオ - ダーにも達する。現行の磁気記録技術における最小ビ ットサイズがサブミクロンオーダーであり、上記磁気ク ラスターサイズと同程度であることを考えると、記録分 解能という点では既に限界に近づいているということが できる。

【0004】現行技術のこのような限界を打破するに は、記録媒体内の磁性粒子を効率よく磁気絶縁し、磁気 クラスターの極小化を図る必要がある。この問題に対す る一つのプレークスルーとして、グラニュラー型媒体が 提案された。グラニュラー媒体は、酸化物等の非磁性マ トリクス中に磁性微粒子を折出させた構造を有し、磁性 粒子間が非磁性物質の介在によりほぼ完全に磁気的に絶 縁されている。

【0005】したがって、個々の粒子(凡そ100~3 00オングストローム程度)が最小の磁化単位となり、

30

3

能となる。実際、最近の研究によれば、SiO.非磁性マトリクス中に磁性粒子を分散析出させたグラニュラー媒体において、高密度記録が可能なこと、そして粗大クラスター形成の回避によるノイズの顕著な低減効果が確認されている。

【0006】以上のように、グラニュラー型媒体は次世代超高密度記録媒体として大変有望な候補であるが、その反面記録状態の熱擾乱という一層深刻な問題を抱えている。この問題について以下に詳述する。

【0007】一般に磁性体は、結晶格子の空間的対称性 10 い。を反映した結晶磁気異方性を示す。例えば、六方稠密構造を有するコバルトでは、結晶主軸(c軸)方向にスピンが向いた場合がもっとも磁気的エネルギーが低く、そ物、の方向からずれるとエネルギーが高くなり、直交方向では最大となる。

【0008】つまり、外場による強制がなければ、常にスピンは c 軸方向の二方向のいずれかを向くことになる。このスピンの向きの二値情報を活用したものが、磁気記録の基本である。一個の磁性粒子に着目した場合、その磁気異方性エネルギーは、物質そのものにより決ま 20 る磁気異方性定数に粒子体積を乗じたものが、全エネルギーとなる。このエネルギーが安定方向へのスピン拘束度を支配し、記録状態の保存につながるわけである。

【0009】もし、磁性粒子の体積が極端に小さくなり、磁気異方性エネルギーが熱エネルギーと同程度になった場合を考えると、熱援乱によりスピンの向き(つまり記録状態)は常に揺らいだものとなり、もはや記録状態を安定に維持できなくなる。上記グラニュラー媒体は、極微小な粒子が非磁性物によりほぼ完全に孤立化されてるため、この熱擾乱が極めて深刻な問題となる。このために、グラニュラー媒体では、記録情報の熱的安定性や長期保存性が問題となり、その実用化は困難視されていた。

【0010】こうした問題を解決するには、本質的に磁性体の異方性エネルギーを高める必要があり、その方法としてCosoPtso、FesoPtsoなどCuAu型構造の高い結晶磁気異方性を有する規則合金を用いることも考えられる。しかし、一般にこうした材料は合成温度が非常に高く、量産化には適さないものであった。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来研究されてきたグラニュラー型媒体が抱える記録状態の熱的、経時的不安定性という問題を解決し、信頼性に優れた高密度記録媒体およびその製造方法を提供することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の磁気記録媒体は、基体上(あるいは基体上の下地層上)に形成された 強磁性粒子からなる強磁性粒子層、または基体上の非磁 性マトリクス中に強磁性粒子が成長してなる強磁性粒子 50

層を有する磁気記録媒体において、前記強磁性粒子がF_{1-x}M_x(F:Fe、Co、M:Pd、Ir、Pt)の組成からなるCuAu型規則構造を有し、かつ前記F_{1-x}M_xに対する原子存在比率が0.3以内の非磁性添加元素Y(Y:Ag、In、Au、Pb、Bi、Sn、Sb)が含有されることを特徴とする。

【 0 0 1 3 】 ことにおいて、F_{1-x}M_xに対するYの原子存在比率を0.01~0.3の範囲とすることが好ましく、0.03~0.2の範囲とすることがより好まし

【0014】また、結晶主軸が主に強磁性粒子層面の法線方向にあることが好ましく。非磁性マトリクスは炭化物、窒化物、酸化物またはこれらの混合物からなることが好ましく、より具体的には、 SiO_1 , MgO, AI_2 O₁, In_2O_1 のいずれか1種以上からなることが好ましい。

【0015】一方、上記において、x=0.40~0.65が好ましい。との範囲においてCuAu型規則構造が形成され、さらに熱的、経時的安定性がより一層向上する。

【0016】強磁性粒子層の厚さは100nm以下が好ましく、50nm以下がより好ましい。

【0017】基体としては、熱膨張係数が2×10⁻⁵/℃以下のものが特に好ましい。表面酸化Siウェハ(~2×10⁻⁵/℃)、溶融石英基体(0.4×10⁻⁵/℃)等が好適に用いられる。これら基体に50nm以下のFePt-Ag/SiOz膜を形成熱処理を施すと、基体の熱膨張係数の小さいものほど規則度及び(001)配向の顕著な改善が認められる。これは基体と膜との熱膨張係数の差により膜が歪み(引張応力)を受け、この応力の存在により規則度そして配向が向上するのではないかと推測される。

【0018】また、下地層についても基体の場合と同様に熱膨張係数の小さいものほど好ましい。下地層としては、C、Si、酸化物(SiO₂、MgO、Al₂O₃等)、炭化物(SiW、WC等)、窒化物(BN等))からなる層であることが好ましい。

【 0 0 1 9 】本発明の磁気記録媒体の製造方法は、強磁 40 性体 F_{1-x} M_x (F: Fe、Co、M: Pd、Ir、P t)、非磁性添加元素 Y (Y: Ag、In、Au、P b、Bi、Sn、Sb)を同時に基体上(あるいは基体 上に形成された下地層上)に堆積させることを特徴とす る。

【 0 0 2 0 】また、本発明の磁気記録媒体の製造方法は、強磁性体F_{1-x}M_x(F:Fe、Co、M:Pd、Ir、Pt)、非磁性添加元素Y(Y:Ag、In、Au、Pb、Bi、Sn、Sb)、及び非磁性マトリクス材料を同時に基体上に堆積させることを特徴とする。

) 【0021】上記製造方法においても、強磁性体F,--*

20

Mx (F: Fe、Co、M: Pd、Ir、Pt)、及び $F_{1-x}M_x$ に対する原子存在比率が0. 3以内であること が好ましい。

【0022】本発明の磁気記録媒体の製造方法は、強磁 性体F_{1-x}M_x(F:Fe、Co、M:Pd、Ir、P t)、非磁性添加元素Y(Y:Ag、In、Au、P b、Bi、Sn、Sb)、及び非磁性マトリクス材料を 同時に基体上に堆積させることを特徴とする。

【0023】上記製造方法において、強磁性体F,-,M. (F:Fe、Co、M:Pd、Ir、Pt)、及びF 1-xMxに対する原子存在比率が0.3以内の非磁性添加 元素Y(Y:Ag、In、Au、Pb、Bi、Sn、S b)を同時に非磁性あるいは軟磁性基体上に堆積させる ことが好ましい。

[0024]

【作用】本発明者等は、上記従来技術が抱える記録状態 の熱的および経時的不安定性という問題を解決するため に鋭意検討した結果、F_{1-x}M_x(F:Fe、Co、M: Pd、Ir、Pt)の組成からなるCuAu型規則構造 の強磁性粒子集合体あるいはグラニュラー構造を作製す る際、非磁性元素Y(Y:Ag、In、Au、Pb、B · i、Sn、Sb)を所定量添加することにより、磁気特 性を劣化させること無く規則化温度を著しく低減できる ことを発見した。これにより、高い結晶磁気異方性のF 1-xMx規則合金微粒子集合体を、量産化レベルの低い温 度で合成することが可能になった。すなわち、従来は6 50℃以上の温度が必要であったが、本発明において は、300~600℃の温度においても規則化が達成さ れる。ただ、300℃未満では条件によっては良好な規 則が達成されない場合がある。300~600℃の範囲 において、400~550℃が好ましく、450~50 0がより好ましい。

【0025】上記非磁性元素Yの添加量について、磁気 特性を損なわない範囲で規則化温度の低減が顕著に認め られるのは、 $F_{1-x}M_x$ に対するYの原子存在比率が0. 3以内であった。より望ましい比率としては0.01~ 0. 3であり、更に望ましくは0. 03~0. 2であっ た。以上のような少量の元素Yの添加により、F_{1-x}M_x の規則化温度は、それを添加しない場合に比べ、100 *C以上低減した。

【0026】本発明の効果は、特に次のような場合に顕 著に現れる。第一は、下地層を介すかあるいは介さない で基体上にF_{1-x}M_x規則合金膜を形成する場合である。 特に膜厚が100mm以下と薄い場合に、元素Yの添加 による規則化温度の低下は着しい。ここでF1-xMxの規 則化は、成長時の基体温度を高くすることによっても実 現されるし、不規則相を形成した後の熱処理によっても 可能である。いずれの場合にも元素Yの添加による規則 化温度の低下が顕著に認められる。

ースは、F_{1-x}M_xと非磁性マトリクス材料を同時に基体 上に堆積させる、いわゆるグラニュラー膜の場合であ る。この場合には、膜中に元素Yを所定量添加すれば、 先の例と同様に顕著な規則化温度の低減を実現できる。 このケースでは、磁性合金F_{1-x}M_x微粒子が非磁性マト リクス中に分散した形態となるが、このような相分離及 び規則化を進行させる手段として、上記第一の場合と同 様に成長時の基体加熱あるいは成膜後の熱処理のいずれ をも選択できる。熱処理の温度は、膜の厚さにもよるが 10 堆積時の基体温度と同様の温度を適用すればよい。

【0028】本発明の検討中に見出された更に有用かつ 興味深い現象として、元素Yの添加によるF_{1-x}M_x規則 合金の優先配向がある。以下にその内容を述べる。F ı-xMx(F:Fe、Co、M:Pd、Ir、Pt)合金 は、x~0.5付近でCuAu型規則構造をとる。この 時にF、Mがランダムに配列した面心立方構造(fc c) の不規則相から、一軸方向に伸縮した面心正方構造 (fct)の規則相に規則-不規則変態を起こす。この 伸縮した結晶軸方向((001)方向)には、一原子層 毎にFとMが交互に積層されたいわゆる原子レベルでの 超格子が形成される。

【0029】このような原子配列の異方性は、一般に極 めて強い磁気異方性を生み出す。従って、F_{1-x}M_x規則 合金微粒子の結晶軸の配向状態は磁気特性を支配するた め、結晶配向の制御は極めて重要な課題となる。FeP tあるいはCoPt規則合金などを例にとれば、(00 1)が磁化容易軸となり、その磁気エネルギーは101 e r g/c c台にも達する。今回我々が新たに見出した 現象は、少量の非磁性元素Y(Y:Ag、In、Au、 Pb、Bi、Sn、Sb) の添加により、特に膜厚50 30 nmという薄い領域において、前記二つのケースいずれ の場合にも、ほぼ理想に近い f c t (001)配向が実 現されることである。つまりfct(001)軸は膜面 法線方向に向き、その結果面直方向に強い磁気異方性が 現れる。例えば、FePtやCoPt規則合金などでは ほぼ理想的な垂直磁化膜となり、垂直磁気記録に好適な 材料となる。

> 【0030】以下、本発明を実施例により説明する。 [0031]

【実施例】(実施例1) S i O, ターゲットとCo-5 Oat. %Ptターゲットをスパッタリングし、溶融石 英基板上に全体膜厚が約100nmとなるよう同時堆積

【0032】また、添加元素の影響を調べるために、A gチップをCo-Ptターゲット上に配置し、同様にス パッタを行った。

【0033】その後、1×10-6Torr以下の真空中 で450℃で1時間熱処理をおこなった。

【0034】Co-Ptに対するAgの原子存在比率R 【0027】本発明の効果が顕著に認められる第二のケ 50 はEDXにより決定し、Rを0.03~0.3の範囲で 変化させた。結晶構造及び規則化パラメターSはX線回折から決定した。磁気特性はSQUID(最大印加磁場 9T)により測定した。測定結果を表1にまとめる(試料 $1\sim5$)。

【0035】表中、Hciは面内方向保磁力、Hcpは面直方向保磁力を示し、結晶配向性は積分回折強度比ァ = [002/([111+ [002+[100])を目安として評価した。

【0036】なお、保磁力が大きいほど磁気粒子の異方性エネルギーは高く、その結果、磁気粒子は熱擾乱の影 10響を受けにくく安定性に優れていることを意味する。

【0037】(実施例2)実施例1と同様の条件で添加元素AgをIn、Au、Pb、Biに替えて試料作製をおこなった。結果を表1に示す(試料6~9)。

【0038】(実施例3) 実施例1と同様の条件下で、添加元素をAg(R=0.1) として、全膜厚を $2\sim1$ 00 n mの範囲で変化させた。結果を表1 に示す(試料 $10\sim13$)。

【0039】(実施例4)酸化シリコンウェハ-基板を 【0047】加熱 450℃に加熱した状態で、Fe-50at. %Ptに 20 を替えて行った。 R=0.08のAgを含有する膜を15nm堆積し測定 【0048】30 試料とした。結果を表2に示す(試料27)。 た。250℃では

【0040】(比較例1)実施例1と同様の条件下で、Agを添加元素せずに、試料作製をおこなった。結果を表1に示す(試料14)。

【0041】(比較例2)実施例2と同様の条件下で、 Al、Ti、Zn、Cu、、Mo、Rh、Ta、W、を 添加し、試料作製を行った。結果を表1に示す(試料15~22)。

【0042】(比較例3)実施例3と同様の条件下で、Agを添加せずに試料作製をおこなった。結果を表1に示す(試料23~26)。

【0043】(比較例4)実施例4と同様の条件下で、 Agを添加しないFe-50at. %Pt膜を作製した。結果を表2に示す(試料28)。

【 0 0 4 4 】 (実施例 5) 基板をN i PコートA I 基板 (熱膨張係数~3×10⁻³/℃) に替え実施例 I と同様 の試験を行った。

【0045】溶融石英基板を用いた実施例1の場合が本例より規則化度及び(001)配向は優れていた。ただ、本例は、従来例よりは規則化度及び(001)配向は優れていた。

【0046】(実施例6)上記実施例では、堆積後に熱処理を行ったが、本実施例では、堆積後の熱処理に替えて堆積時に基板の加熱を行った。

【0047】加熱温度は250~600℃の範囲で温度 0 を替えて行った。

【0048】300の温度においても規則化が達成された。 250 °Cでは必ずしも良好な規則が達成されなかった。 $400\sim550$ °Cにおいてより良好な結果が得られ、 $450\sim500$ においてさらに良好な結果が得られた

[0049]

【表1】

試料	添加元素	R	膜厚 (nm)	s	γ	Hci (k0e)	Hcp (k0e)
1	Ag	0.03	100	~1.0	0. 1	8. 4	4. 9
2	Ag	0.08	100	~1.0	0.1	9. 1	5. 2
3	Ag	0.1	100	~1.0	0.1	8. 2	4. 1
4	Ag	0.3	100	0. 9	0. 1	7. 7	3. 9
5	Ag	0.4	100	0. 6	0. 1	3.8	1.6
6	In	0.1	100	0. 9	0. 2	7. 3	3. 7
7	Au	0.1	100	~1. 0	0. 1	8. 4	4. 7
8	Рb	0.1	100	0. 9	0.15	7.4	5. 2
9	Вi	0.1	100	~1.0	0. 1	7. 7	4. 4
10	Ag	0.1	2	~1.0	1. 0	1. 9	10. 5
11	Ag	0.1	10	~1. 0	1. 0	1. 8	11.0
12	Ag	0.1	3 5	~1.0	0. 9	2. 6	8. 7
13	Ag	0.1	60	~1.0	0.5	4.8	6. 5
14	–	0	100	<0.1	0	0. 6	<0.1
15	A 1	0.1	100	<0.1	0	0.3	<0.1
16	TI	0.1	100	<0.1	0	<0.1	<0.1
17	Zn	0.1	100	<0.1	0	0. 2	<0.1
18	Cu	0.1	100	<0.1	0	0.3	<0.1
19	Мо	0.1	100	<0.1	0	<0.1	<0.1
20	Rh	0.1	100	<0.1	0	<0.1	<0.1
2 1	Та	0.1	100	<0.1	0	0.4	<0.1
2 2	w	0.1	100	<0.1	0	0. 2	<0.1
23		0	2	<0.1	0	0	<0.1
24	–	0	10	<0.1	0	<0.1	<0.1
2 5	–	0	3 5	<0.1	0	0. 1	<0.1
26	-	0	60	<0.1	0	0.3	<0.1

[0050]

* *【表2】

試料	添加元素	R	膜厚 (nm)	s	τ	Hci (k0e)	Нср (k0e)
2 7	Ag	0.08	1 5	~1.0	1	4. 3	
2 8	-	0	1 5	<0.1	0	0. 4	

ゲットをスパッタリングし、溶融石英基板上に全体膜厚 が約30nmとなるよう堆積した。

【0052】また、添加元素の影響を調べるために、S n、SbチップをCo-Ptターゲット上に配置し、同 様にスパッタを行った。

【0053】その後、1×10-°Torr以下の真空中 で450°Cで1時間熱処理をおこなった。

【0054】Co-Ptに対するSn、Sbの原子存在 比率RはEDXにより決定し、Rを0.03~0.3の 範囲で変化させた。結晶構造及び規則化パラメターSは 50 【0057】

【0051】(実施例7) Co-50at. %Ptター 40 X線回折から決定した。磁気特性はSQUID(最大印 加磁場9 T) により測定した。測定結果を表3にまとめ る(試料29~34)。

> 【0055】表中、Hciは面内方向保磁力、Hcpは 面直方向保磁力を示し、結晶配向性は積分回折強度比で = I.o., / (I.11+ I.o., + I.o.) を目安として評価し

> 【0056】(比較例5)実施例7と同様の条件でS n、Sbを添加せずに試料作製を行った。結果を表3に 示す(試料35)。

12

【表3】

試料	添加 元素	R	膜 厚 nm	S	7	Hc i kOe	Hcp kOe
2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5	Sn Sn Sb Sb Sb なし	0. 05 0. 1 0. 3 0. 05 0. 1 0. 3	3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0	0. 15 0. 2 0. 2 0. 3 0. 35 0. 4 0. 01	0. 10 0. 15 0. 45 0. 3 0. 42 0. 5	2. 6 4 5. 7 4. 5 5. 7 6 0. 2	0.8 1.4 2.6 1.6 2.7 2.6 0.05

[0058]

【発明の効果】本発明によれば、従来研究されてきたグ ラニュラー型媒体が抱える記録状態の熱的、経時的不安* るという顕著な効果を達成することができる。

*定性という問題を解決し、信頼性に優れた高密度記録媒 体およびその製造方法を提供することを目的ことができ

フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

FΙ

ターマコード(参考)

H 0 1 F 10/26

H 0 1 F 10/26

41/16

41/16

Fターム(参考) 5D006 BB01 BB06 BB07 BB09 CA01

CB01

5D112 AA05 BB01 BB06 FA04 FB19

GB01

5E049 AA01 AA04 AA09 BA06 BA08

D804 E806